5. 光學玻璃之高精密微型研鑽技術開發

摘要

本研究主要是利用創新的桌上型微鑽孔機進行 研鑽技術之開發,此微鑽孔機結合了微放電加工與研 鑽技術,能在光學玻璃上成型精密微孔。首先是以銅 為基材之燒結合金鑽石刀具,利用逆向同心微孔放電 加工及逆向微線切割,將鑽石磨棒加工出同心的空心 軸及負後斜角造型,加工完成之刀具,可直接對光學 玻璃或石英進行研鑽。此外,荷重元的加入可偵測研 鑽時所產生的及時壓應力,並回饋到刀具的進給速率 上。實驗結果顯示,微孔在尺寸與幾何形狀都能達到 很高的精度,且本研鑽技術方法簡易、成本低廉,對 微製造產業將能有顯著的貢獻。

關鍵字:逆向同心微孔放電加工、逆向微線切割、 研鑽技術、光學玻璃

一、前言

現今許多產品多朝向微小化的趨勢發展,除了 符合經濟效益且較能吸引消費者之外,也能節省空 間、減少廢物產生及能源消耗。除了3C產品外,其 他如光電產品,生物醫學儀器及通信系統也都有此 趨勢。其中,光學玻璃更是在上述應用中扮演著舉 足輕重的角色,尤其是觸控面板,為了因應各種產 品需求,對光學玻璃進行切削、鑽孔、磨削等加工 程序,都是無法避免的。由於光學玻璃具有高硬度 及脆性,許多具有高效率及高精度的加工技術也隨 之發展起來,例如超精密加工[1,2]、蝕刻[3]、放電 加工[4]及雷射加工[5,6],還有超音波震動輔助加工 [7,8],這些加工方法都有其應用的場合,但這些加 工設備大都非常昂貴因而只適合大規模的生產;其 產生的有毒化學物質亦會對環境造成威脅。因此, 在考慮光學玻璃元件的加工方法時,除了須克服其 先天的硬脆特性,加工方法、經濟效益及對環境的 影響都需要一併考慮。

本研究將重新審視傳統加工概念及商業價值, 以開發一結合高精度研鑽技術及逆向放電加工技術 之桌上型微鑽孔機,這項發明將會在實驗中得到驗 證。本研究所使用之鑽石刀具,透過線上的逆向放 電加工技術,加工出同心空心軸及多刃結構的特殊 造型,以利在光學玻璃上成型精密微孔,而荷重元 感測機制能及時偵測研鑽時所造成的壓應力,並對 進給速率作出及時的回饋調整。研鑽過程將會一層 陳順同¹、江宗翰²、吳宜穎²、楊弘意³ ¹國立台灣師範大學 機電科技學系教授 ²國立台灣師範大學 機電科技學系專題生 ³國立台灣師範大學 機電科技學系研究生

一層的進行,本研究亦會在實驗中對尺寸精度、幾 何精度及刀具壽命作出評估。

二、研究方法

2.1 鑽石刀具同心微孔放電加工

圓柱形鑽石刀具在鑽孔過程中,其切削速度V (m/min)如式1所示。

$$V = \frac{\pi DN}{1000}$$
(1)

其中D(mm)為鑽石刀具直徑 · 1000為修正系 數 · N(rpm)為磨棒轉速。由式(1)可知 · 磨棒中心靜 點位置沒有切削速度(因D=0) · 為避免此點對玻璃工 件造成擠壓 · 必須將磨棒軸心去除。本實驗採磨棒 在上 · 銅管電極在下的倒置方式進行放電加工 · 在 放電加工的同時 · 銅管電極與鑽石磨棒分別以20及 500rpm同時反方向旋轉 · 如圖1(a)所示。此"逆向 同心微孔放電加工"是將刀具軸心與銅管電極中心 對齊並加上啄鑽模式的加工 · 如圖1(b)所示。啄鑽模 式的抽吸效果使放電殘渣能因壓力差及重力而快速 由下自動排出 · 亦可減少放電短路的頻率[9]。而所 謂的"同心微孔"指的是微孔與圓柱型刀具有相同 的圓心 · 而此微孔可加速切屑的排除並減少加工時 的熱聚積。



2.2 適當的放電能量及進給率

在微鑽孔機中 · RC放電迴路提供微放電加工所 需的能量 · 這個能量使放電電流有短脈衝及高峰值 電壓[10] · 為了找出同心微孔放電加工的最佳放電效 率 · 鑽削率DR如式(2)所示。

$$DR = \frac{dad}{dpd}$$
(2)

其中dad和dpd分別表示放電鑽孔後的實際深度 及預測深度。本實驗放電加工條件如表1所示,固定 進給速度0.2mm/min,放電能量分別以3000,9000, 15000與21000pF進行實驗,比較加工時間、加工深 度與加工效率。由實驗結果圖2(a)觀察得知,當電 容設定3000pF時,雖可獲取最大的實際深度,但因 為放電能量過低,使致材料去除率降低,放電短路 情況增加,延長加工時間。但當能量提高為9000、 15000、21000(pF)時,所得到的加工時間相當接 近,這意味著當提供過大的能量時,消耗量大部分 集中於銅管電極上,這將使加工效率降低。適當的 加工能量,可使材料去除率、銅管消耗率與進給速 度達到平衡,得到大的鑽孔深度與最理想的加工效 率。為了使加工效率與加工時間達到平衡,故本研 究選用15000pF為最理想放電能量。

Parameters	Conditions	
Electrode	brass tube (φ 0.3 mm)	
Work-piece	Diamond-tool(\$1.0mm)	
Working voltage	100 (V)	
Feed-rate	0.4 (mm/min)	
Tool speed	500 (rpm) (CW)	
Tube speed	20 (rpm) (CCW)	

表1.加工條件



圖2(a) 能量與鑽削效率關係曲線

在進給速度控制方面,速度太快或太慢對於放 電情況都不理想,適當的進給速率,不僅可以讓放 電情況正常,也可以使銅管電極在安全的放電行為 內,以最快速率前進,減少加工時間,提高加工效 率。當進給速率小,放電情況最理想,加工短路情 況也最少,但加工時間相對增加。隨著進給速度提 高,可以獲取有效率的加工時間,但進給速度過大 時·材料及銅管電極會來不及被放電去除而發生加 工短路現象·影響加工時間與加工精度。由實驗結 果圖2(b)得知·當速度設定為0.4mm/min時·可獲得 最低的加工時間(169秒)·為最理想的加工效率。



圖2(b) 進給速度與加工時間關係曲線

圖3(a)顯示了令人滿意的加工結果,經掃描式 電子顯微鏡(SEM)線上檢驗後,測得其同心微孔直徑 為330 μm,單邊放電間隙僅15 μm。更有趣的是, 因為銅管電極的關係,在同心孔中心殘留了一微 桿,如此更證實此加工孔之真圓度與同心度是絕對 真圓與絕對同心的。將微孔內壁局部放大,如圖3(b) 所示,鑽石磨料粒均勻分佈在銅基材中,這些間隔 20-50 μm的裸露鑽石提供了銳利的切刃及容納切屑 的屑袋,以利磨削。



圖3(a) 同心微孔加工結果



圖3(a) 同心微孔內壁近觀

2.3 鑽石刀具負後斜角加工

因考慮切削力及切屑的儲存空間,鑽石刀具的端面 不能太平坦,除了去除刀具的軸心外,本研究對鑽 石刀具亦提出了多刃負後斜角的設計。硬脆材料如 光學玻璃較適合承受壓應力,而負後斜角(α=-60°) 的設計能對光學玻璃產生負角切削,如圖4(a)所示。 透過數控工具機產生的路徑,六刃的負後斜角切刃 將很容易在微放電線切割線上加工完成,如圖4(b)所 示。本實驗將鑽石磨棒端面圓形等分為三等份,將 每一等份採用相同的V行路徑將其端面割出V溝,三 等份加工完成後,便可形成六刃負後斜角。切刃的 幅射對稱能平衡磨削力的作用。值得注意的是,由 於鑽石刀具並未被拆卸直到加工結束,所以能維持 精確的加工精度。圖5(a)為加工完成之鑽石刀具。初 步的實驗結果顯示,若無負後斜角切刃,將很難在 光學玻璃上完成鑽削的動作,如圖5(b)左所示,圖 5(b)右則為成功的研鑽加工。切刃提供了銳利的刀刃 及容屑的空間,不僅可維持刀具壽命,也可防止切 **屑堵塞刀具**,從而得到高圓度的微孔。



圖4(a) 負角切削



圖4(b) 逆向微放電線切割



圖5(a) 完成負後斜角之鑽石刀具



圖5(b) 刀具有無後斜角之鑽孔比較

三、系統介紹

3.1 桌上型微鑽孔機開發

圖6(a)為本研究設計之桌上型微鑽孔機,其主 要設計如下:垂直的C型結構;Z軸的伺服線性馬 達可進行自動的研鑽加工;主機頭上裝置一高速主 軸;另有一平衡機制,用來平衡主機頭重量;最後 是手動的X、Y軸精密移動平台。複合式工作槽則利 用兩個在對角線的錐銷及兩根螺栓精密定位在工作 檯上,此複合工作槽可進行兩種微加工技術:逆向 同心微孔加工及研鑽技術。而垂直安裝在主機頭上 的高速主軸,具有精密直流馬達,可提拱刀具穩定 的轉速,此外,高速主軸亦可定位工件(如鑽石刀具),使其能夠加工出特殊造型。圖6(b)為本研究開發 之微鑽孔機實體。



圖6(a) 桌上型微鑽孔機設計圖



圖6(b) 桌上型微鑽孔機成品

3.2 高精度逆向微放電加工

欲使用圓棒狀的鑽式刀具,以純機械的方式在 脆性玻璃上成型一精密微孔是相當困難的。磨棒中 心因切削速度為零且缺乏容屑的空間而產生擠壓效 應;也因為磨擦的關係,微小切屑會附著在刀具及 工件表面,造成加工困難。本研究提出一個去除刀 具軸心的簡單策略,除了防止中心擠壓效應,也能 提供切屑暫存的空間。因此,我們便開發了逆向同 心微孔放電技術,以符合鑽孔機線上加工特殊鑽石 刀具的需求。圖7(a)為所設計之小型低速主軸機構, 一外徑為0.3-mm之銅管電極垂直架設於有兩V型軸 承之支架上,並將其軸心與鑽石磨棒互相對齊。電 極軸端套一精密鋼珠與導電材料(Conductor)接觸, 使電極轉動時產生『點』接觸,可將摩擦降至最 低,並達到導電效果。加工軸與傳動軸之間以低速 皮帶傳動,傳動軸皮帶輪與加工軸皮帶輪保持高低 位置差,使皮帶與水平線成一夾角θ,此傾角θ不 但能使低速皮帶拉緊加工軸,貼緊V型軸承,更能 使加工軸往下移動頂住鋼珠,以保持良好的導電效 果,同時,加工軸只能轉動,不能軸向滑動或徑向 跳動,亦即加工軸的『自由度為1』。此設計概念驅 使加工件以低摩擦、單一自由度穩定地於機構上運 動,以此方法加工的微型圓柱體零件,真圓度及圓 筒度可達到最高。圖7(a)左上方顯示了電極與加工件 之間裝置一眼模(Pipe guide)加以拘束,透過此拘束 行為,不僅可抑制電極擺動現象,使放電行為維持 穩定,也大大降低加工孔之擴孔現象。此逆向放電 加工機制將能精確去除鑽石磨棒之軸心。



圖7(a) 逆向同心微孔放電加工機制

逆向微線切割是由線放電研磨機制改良而來, 它是由一金屬圓盤來輸送精密的微小電極[11]。這 項設備裝置在本實驗事先前開發之CNC工具機中, 用來加工鑽石刀具端面的特殊造型,如圖7(b)所示 [12]。(為了商業目的,逆向微線切割裝置未被安裝 在本研究之微鑽孔機上)。此逆向微線切割裝置未被安裝 在本研究之微鑽孔機上)。此逆向微線切割裝置未被安裝 在本研究之微鑽孔機上)。此逆向微線切割、有一精 密V型槽圍繞在金屬圓盤的圓周上,可讓銅線(直徑 0.25mm)緊密接觸並維持穩定的傳動。將鑽石磨棒(已完成同心微孔加工)連同高速主軸從微鑽孔機上移 至先前開發之CNC工具機中,經由逆向微線切割裝 置來對磨棒端面進行特殊造型切割。逆向的加工方 式可使切屑藉由重力影響而快速排出,除了可縮段 加工時間,也能減少放電短路的機會。

四、實驗結果

4.1 及時壓力偵測與回饋



圖8(a) 荷重元感測機制



圖8(b) 鑽削力(Fd)與及時電壓(Vr)之線性關係圖

4.2 光學玻璃及石英之微孔鑽削

這個部分將驗證對光學玻璃及石英進行研鑽加 工之可行性。在理想條件下,對光學玻璃一層一層 的磨削,由於鑽石刀具之六刃切刃造型,在每次進 給中會有六個接觸點。若令每轉進給量為Fr,則單 獨一個切刃的進給量Ft將為每轉進給量的六分之一 (Ft標示於圖4(a)),因此,每分鐘之進給量將可表示 如下:

$$F_m = F_r N = 6F_t N \tag{3}$$

在脆性材料磨削過程中, 脆性轉延性是個重要 的去除機制[13,14],為確保脆性材料能以延性方式 磨削,因此須找出進給量之臨界深度(Critical cutting depth),即為最小進給深度,材料切除便能以塑性 變形(Plastic deformation)為主,以防止微細裂紋產 生。事實上,當考慮加工材料的硬度及鑽石磨料粒 之負載時,除了要降低每一切刃(Ft)的負載外,通 常轉速N也須超過其理論轉速。本實驗所使用之光 學玻璃及石英,其硬度分別為莫氏英度六和七, 2500rpm的轉速將能穩定鑽穿工件,光學玻璃及石 英所對應的進給率分別為0.16µm/rev及0.12µm/rev, 因此,每刃的切削量約為20-27nm,將能形成延性 磨削。過高的轉速和太大的進給深度將會導致刀具 及工件磨損,表2為光學玻璃及石英的物理性質[15] 及加工條件。

衣2.元字双项及口央之彻理性具兴加上除什

Parameters	Optical glass	Quartz
Compressive strength	1.0 x 109 pa	1.1 x 109 N/m2
Tensile strength	4.2 x 107 pa	4.8 x 107 N/m2
Hardness	MS 6.5	MS 7.0
drilling depth	4 mm	4 mm
Spindle speed	2,500 rpm	2,500 rpm
Feed-rate (Fm)	0.4 mm/min	0.3 mm/min

圖9(a)比較了有無荷重元感測機制對微孔入孔 處之影響,結果顯示,當無荷重元感測機制時,光 學玻璃入孔孔緣有著明顯的擴孔現象及嚴重的碎裂 (圖9(a)左側),嚴重的擴孔現象也發生在石英的入孔 孔緣(圖9(b)左側),其原因進給率太快,超過工件所 能負荷,然而,石英因為其更高的硬度、更大的切 削阻力造成刀具的偏擺,而造成較嚴重的擴孔。相 較之下,在圖9(a)、9(b)右側顯示了經荷重元感測機 制改善後之結果,荷重元即時的感測鑽削阻力並回 饋控制進給率,使其保持最佳鑽削速度,因此擴孔 及碎裂現象皆能有效的避免。透過掃描式電子顯微 鏡(SEM)線上檢驗,在光學玻璃及石英上的微孔直徑 分別為1.015mm及1.011mm,由上述結果,荷重元 對光學玻璃研鑽加工的貢獻不證自明。



圖9(a) 光學玻璃微孔鑽削



圖9(b) 石英微孔鑽削

4.3 犧牲層影響

由於硬脆材料的拉伸強度較弱,因此在其邊緣 常有微細裂紋的產生,這類型的裂紋,除了嚴重影響 加工品質,亦會降低工件強度。為避免微細裂紋的發 生,本研究提出了兩個策略,一是降低刀具入孔及出 孔的進給速率,減少鑽削所造成的壓力;二是在工件 底部多墊一層犧牲層以延長其鑽削區(參考圖8(a)示意)。因此,這樣的作法可讓微孔邊緣張應力減少,抑 制微細裂紋的發生。圖10(a)為沒有使用犧牲層,石英 鑽孔的出孔邊緣,相較之下,圖10(b)的石英微孔因為 犧牲層的作用,所產生的崩裂情況較不明顯。



圖10(a) 沒有犧牲層之石英出孔



圖10(b) 有犧牲層之石英出孔

4.4 刀具壽命討論

刀具壽命深深受到光學玻璃及鑽石磨粒的影響,因光學玻璃較鑽石刀具之銅基材硬,那就表示 玻璃粒子可以削弱覆蓋在鑽石磨粒上的銅粒子鍵 結,造成刀具端面磨損。刀具磨損對刀具壽命來 說,是個重要的指標。描述刀具壽命最常使用的就 是泰勒的刀具壽命方程式[16],透過刀具壽命與切削 速度來描述經驗刀具壽命常數C:

 $VT^n = C$ (4)

其中 · V為切削速度(m/min) · T為刀具壽命 (min) · n為相依於切削參數之指數 · 然而式(4)是適 用於單點刀具 · 以找出合理的刀具壽命估計 · 對於 本實驗之刀具因其多刃的結構 · 將難以估計指數 n 及經驗係數C。正因如此 · 另一替代方法為利用刀 具端面之平均磨耗深度(W₄)及加工次數(N_m)來估計 刀具壽命 · 另外 · 用於研鑽功能及儲存切屑的特殊 切刃結構 · 其高度則設為刃深(E_d)(標示於圖4(b))。 對於本實驗之鑽石刀具頭端 · 六個刃深將會平均地 在研鑽過程中逐漸磨耗 · 切刃便會鈍化而造成切削 阻力的增加 · 光學玻璃的研鑽實驗相關數據 : 加工 次數(N_m)、荷重元之偵測電壓(V₂)及刀具端面之平均 磨耗深度(W_d)、其相互關係如圖11(a)所示(兩條實線曲線顯示了回歸關係)。當加工次數(Nm)為30次時、 偵測電壓(V_r)明顯地上升、意味著在那一刻、鑽削 阻力也產生了陡升的現象、其相對應的V_r、W_d及鑽 削力(F_d)分別為0.395V、0.11mm及0.8Kg(圖8(b))。此 時的刀具因為其切刃已磨平、容屑空間大幅減少(圖 11(b))、已無法再有效的加工、因此本實驗獲得的合 理刀具加工次數(N_m)為30次。



圖11(a) 加工次數(N_m)、偵測電壓(V_r)及磨耗深度(W_a)之關 係曲線



圖11(b) 加工30次後之刀具樣貌

五、結論

本研究所開發之桌上型微鑽孔機,成功的以研 鑽技術在光學玻璃上成型微孔。本微鑽孔機包含了 精密Z軸伺服系統、完整的研鑽機制、逆向放電加工 設備、復合式工作槽及荷重元感測機制。透過雙主 軸及雙V型軸承設計與逆向微放電加工的應用,本 研究成功的將鑽石磨棒加工出完全同心微孔及六刃 負後斜角。六刃負後斜角可在研鑽過程中提供壓應 力切削; 奈米等級的切削深度能將脆性材料以延性 模式加工; 荷重元感測機制提供了即時的鑽削力偵 測及精確的回饋機制,確保研鑽時能有最佳的進給 率,以防止微細裂紋與擴孔現象的發生。此外,犧 牲層也能支撐光學玻璃,抑制崩裂的發生。刀具壽 命部分,透過刀具切刃之平均磨耗深度與加工次數 的計算估計,得到刀具加工壽命約為30次。相較於 目前市面上所使用的加工方法,如超音波震動輔助 加工,或是化學蝕刻,本研究所開發之研鑽技術提 供了一簡易、低成本、環保且易於控制的方法來對 光學玻璃鑽孔,預計此研鑽技術的相關特性將可對 精密微製造領域產生極大的貢獻。

參考文獻

- Chen M, An Q L, Lin W M and Ohmori H 2009 Fundamentals of BK7 glass removal in micro/ nano-machining Advanced Materials Research 76-78 485-490
- Saleh T, Rahman M S, Lim H S and Rahman M 2007 Development and performance evaluation of an ultra precision ELID grinding machine Journal of Materials Processing Technology 192–193 287–291
- Lim C S, Hong M H, Kumar A S, Rahman M and Liuc X D 2006 Fabrication of concave micro lens array using laser patterning and isotropic etching International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 552-558
- Cao X D, Kim B H and Chu C N 2009 Microstructuring of glass with features less than 10µm by electrochemical discharge machining Precision Engineering 33 459-46
- Antonyuk B P, Obidin A Z, Vartapetov S K and Lapshin K E 2008 Light driven self-drilling in glasses Optics Communications 281 2139-2144
- Nikumb S, Chen Q, Li C, Reshef H, Zheng H Y, Qiu H and Low D 2005 Precision glass machining, drilling and profile cutting by short pulse lasers Thin Solid Films 477 216-22
- Weber H, Herberger J and Pilz R 1984 Turning of machinable glass ceramics with an ultrasonically vibrated tool Annals of CIRP 33 85-87
- 8. Moriwaki T, Shamoto E and Inoue K 1992 Ultraprecision ductile cutting of glass by applying ultrasonic vibration Annals of CIRP 41 141-144
- Chen S T 2008 Fabrication of a highdensity micro holes by upward batch micro EDM Journal of Micromechanics and Microengineering 18 (9pp)

- 10. Saito C 1979 The Construction and 100% Operational Skills of EDM (in Japanese) Mitsubishi Electric Ltd. 40-69
- Chen S T, Lai Y C, and Liu C C 2008 Fabrication of a miniature diamond grinding tool using a hybrid process of micro-EDM and codeposition Journal of Micromechanics and Microengineering 18 (8pp)
- Chen S T, Yang H Y and Du C W 2009 Study of an ultrafine w-EDM technique Journal of Micromechanics and Microengineering 19 (8pp)
- 13. Sinhoff V and König W 1998 Generative precision grinding of optical glass CIRP Annals
 Manufacturing Technology 47 253-258
- 14. Zhou M, Wang X J, B Ngoi K A and Gan J G K 2002 Brittle–ductile transition in the diamond cutting of glasses with the aid of ultrasonic vibration Journal of Materials Processing Technology 121 243-251
- 15. OPTICAL GLASS DATA BOOK, Sumita Optical Glass Inc. http://www.sumita-opt.co.jp
- 16. Taylor F W 1907 On the art of cutting metals, Transactions of ASME 28 31-58